

Регулирующие шиберные затворы КУКУ CCD-ZM с APC



APC регулирует проводимость между камерой и насосом. Контроллер сравнивает заданное давление с сигналом вакуумметра и меняет положение пластины. Автонастройка учитывает объём камеры и газовую нагрузку. Затвор применяют в процессах нанесения покрытий, микроэлектроники и производства дисплеев.

Технические характеристики

Фланцы	CF / ISO-F
Диапазон давления	10^{-6} – 10^5 Па
Общее натекание	$\leq 1 \times 10^{-10}$ Па·м ³ /с
Перепад при открытии	<3000 Па
Точность положения	$\pm 0,5\%$ FS ($\pm 0,05\%$ полной шкалы)
Точность регулирования давления	$\leq 0,5\%$ FS; в каталоге — 5 мВ
Сигнал мембранного вакуумметра	0–10 В DC
Питание контроллера	36 В DC
Прогрев	≤ 150 °C; контроллер ≤ 50 °C
Ориентация	Уплотняемая поверхность обращена к стороне высокого вакуума

Модели и исполнения

Модель	DN	Фланцы
CCD-100ZM	100	CF / ISO-F
CCD-150ZM	150	CF / ISO-F
CCD-200ZM	200	CF / ISO-F
CCD-250ZM	250	CF / ISO-F

FS — полная шкала. Точность в долях полной шкалы не равна относительной погрешности давления во всём диапазоне. Результат зависит от вакуумметра, газовой нагрузки и настройки контура.

Подбор и внедрение

Для подбора нужны рабочее давление с обеих сторон, газовая среда, температура, число циклов, стандарт фланцев, монтажная схема и интерфейсы управления. Состав поставки и пусконаладочных работ согласуют в техническом задании.

Источник: каталог KUKU, Vacuum accessory (valve, gauges), декабрь 2025; печатные страницы 35–37. Данная карточка не заменяет паспорт, руководство по эксплуатации и согласованный чертёж.

Размерные таблицы, чертежи и актуальная карточка на leaklab.ru

Ликлаб | +7-812-715-00-17 | mail@leaklab.ru